ウルトラピュア大気圧 He プラズマ中の準安定 He 原子の吸収分光測定

日大生産工(院) 〇羽田 拓実 日大生産工(学部) 池田 隼輝 阪大工 北野 勝久 島津製作所 品田 恵 日大生産工 荒巻 光利

1 はじめに

近年,大気圧で生成される低温プラズマの研 究が盛んにおこなわれている。従来の低気圧プ ラズマに対し,真空関連機器が不要なため,低 コストであり,処理対象物に直接照射が可能と いう利点がある。さらに高密度な活性種を生成 できるため医療分野や,農業分野といった産業 応用が進められている。大気圧プラズマ中の準 安定He原子は活性種生成に重要な役割を担っ ており,応用上,その生成過程および輸送は重 要な情報である。また,一般的な大気圧プラズ マの実験では、ppmの不純物を有する高純度ガ スを用いるが、極微量不純物により発光スペク トルが変化することが明らかになっており,極 微量不純物が放電および準安定He原子に与え る影響が注目されている。

本講演では、高純度のHeガスを純化装置に より超高純度化し、それを用いて生成したウ ルトラピュアプラズマ中の準安定原子の分光 計測について発表する。

2 実験方法

2-1 実験系

実験装置をFig.1に示す。誘電体である石英 管(内径4mm, 外径6mm)の外側に銅箔(厚さ 0.01mm, 幅15mm)を巻いて放電電極とし, 交 流高電圧(10kV, 17kHz)を印加する。 プラズマ 生成用ガスはガスボンベから純化装置を通す ことで、不純物濃度をsub-ppm以下にし、この 超高純度Heガスを電離させウルトラピュアプ ラズマを生成した。高電圧電源にはLogy製 LHV-10AC-24, マスフローコントローラーは KOFLOC製MODEL8500,純化装置はバルコ 社製HP-2を用いた。プラズマによって生成さ れた準安定He原子をレーザー吸収分光法で測 定した。大気圧Heプラズマのスペクトルは衝 突拡がりによって大きな線幅をもつため,その 測定には広い範囲で波長掃引出来る波長可変 レーザーが必要になる。本研究では、分布帰還 型(DFB)レーザーをウルトラピュアプラズマ に照射し、フォトダイオードによりレーザー光 の減衰を検出する。

2-2 レーザー吸収分光法の原理

吸収分光法とは、プラズマに外部から光を照 射し,透過光の減衰率からプラズマ内部の原子 や分子の温度・密度を求める方法である。Fig.2 にHeのエネルギー準位図を示す。本実験では 1083nmのDFBレーザーを使用し、 $2^3s - 2^3p$ の遷移による吸収を用いて下準位である準安 定He原子の測定を行った。また,下準位が同じ 準安定He原子である389nmではなく1083nm を用いた理由は、389nmで使用出来るDFBレ ーザーがなく,通常の半導体レーザーを用いな ければならないからである。



Fig.1 Experimental setup



Fig.2 He energy levels

Absorption Spectroscopic Measurement of Metastable Atoms of Ultrapure Atmospheric Pressure Helium Plasmas

> Takumi HADA, Toshiki IKEDA, Katsuhisa KITANO, Kei SHINADA, and Mitsutoshi ARAMAKI

3-5

4 ウルトラピュア大気圧Heプラズマ

Fig.3は純化装置の電源を入れた直後からの プラズマの様子をカメラで撮影した写真であ る。時間が経つとプラズマの発光が強くなり, 細くなっていることがわかる。これは不純物濃 度がppmからppbまで減ることで放電の形態 が変わったためであると考えている。本研究で はこれをウルトラピュアプラズマと称してい る。

5 実験結果

純化装置の電源を入れてからの吸収率の時間 変化を測定した。Fig.4は吸収率の時間変化を示 している。パルス放電が起きる度に4µsの遅れ で準安定He原子による吸収が観測される。こ れは電極付近で生成された放電フロントが移 動して準安定He原子を生成しているため、レ ーザーを通している電極横2cmに移動してく るまでのタイムラグだと考えられる。純化装置 をつけた初期に吸収の最大値、ディケイタイム が短くなるのは純化装置から出てくる不純物 の影響だと考えられる。徐々に不純物が減るこ とで、吸収の波形は大きくなっていることが確 認できる。

Fig.5は吸収のピーク値とディケイタイムの 推移を表したグラフである。ディケイタイムが 長くなっていることから、不純物が減り、準安 定He原子の寿命が延びていることを示してい る。また、吸収率が上がっていることから準安 定He原子の生成量が増えていることがわかる。

6 まとめ

本研究では、高純度 He ガスを純化装置に通 すことでウルトラピュア大気圧 He プラズマを 生成し、分光計測を行った。本実験結果から、 ウルトラピュアプラズマ中では準安定 He 原子 のディケイタイムは 7 µs 長くなり、吸収率は 10%以上増えていることが分かった。今後は、 発光スペクトルを調べて残っている不純物を 同定し、より純度の高いプラズマを生成できる よう検討する。



Fig.3 Temporal variation of plasma after gas purifier ON



Fig.4 Temporal variation of pulsed absorption time after gas purifier ON



Fig.5 Temporal variation of maximum absorption and decay time of the pulsed absorption signal

「参考文献」

- 北野勝久,浜口智志,低周波大気圧マイク ロプラズマジェット,応用物理,第77巻, 第4号,(2008) p.383-388.
- と部継一郎、大気圧誘電体バリア放電の分光学的研究、京都大学博士学位論文、 (2012).